

Empyrean EmapFPD™

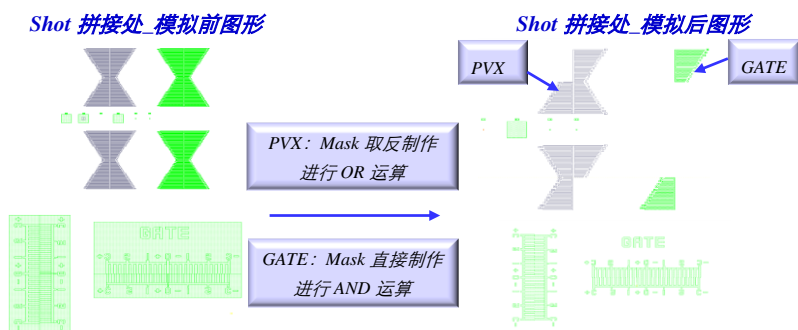
掩膜分析模拟工具套件

亮点

Empyrean EmapFPD™工具提供Mask高级分析模拟功能，包括Exposure Analysis分析，MRC检查，Split Panel，马赛克分析以及Job File工具等。

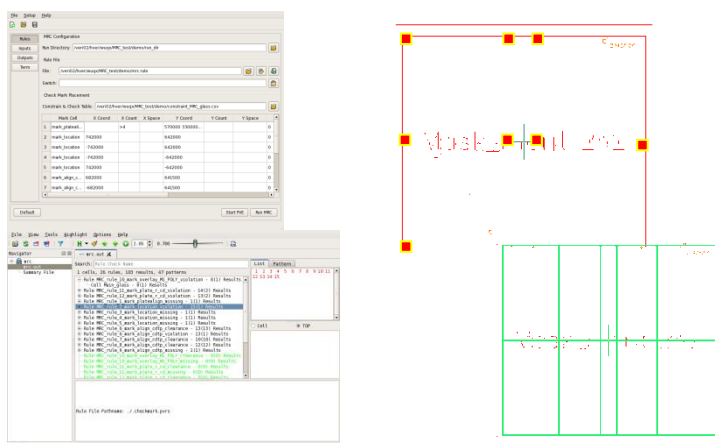
- EmapFPD-EA (Exposure Analysis)：曝光分析工具，避免版图设计在Photo流程中出错，如图示1所示。

- 支持Mark设计规则及净空区检查
- 支持切割0宽度Path
- 支持重复切割区
- 支持对Array进行切割，结果保持Hierarchy，自动创建Cells
- 支持创建IPS等异型结构的Mosaic
- 支持Mosaic和Subpixel Outline错位，可以使切割部位错开图形，提高良率
- 支持基于关键词的工艺模板技术
- 支持基于矢量图的缩略图
- 全自动根据模板提取数据，填写工艺文件



图示1-Exposure Analysis模拟工艺过程

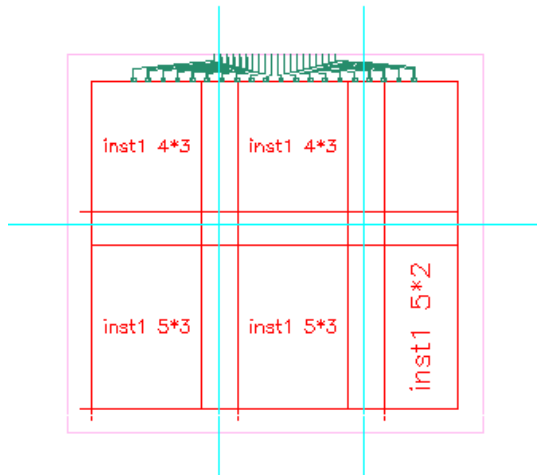
- EmapFPD-MRC (Mark Rule Check)：Mark设计规则检查工具，避免版图上的Mark丢失或净空区出错，如图示2所示。



图示2-MRC检查

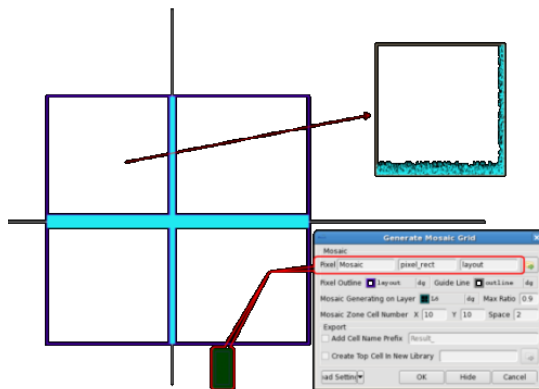
- EmapFPD-SP (Split Panel)：版图切割工具，切割Panel版图产生不同Shot的Mask版图，包含Split Panel和马赛克分析等工具；

- Split Panel：版图切割工具，用以切割Panel版图成不同Shot的Mask版图。在Split Panel中有选项可以调用Mosaic Analysis工具，如图示3所示。



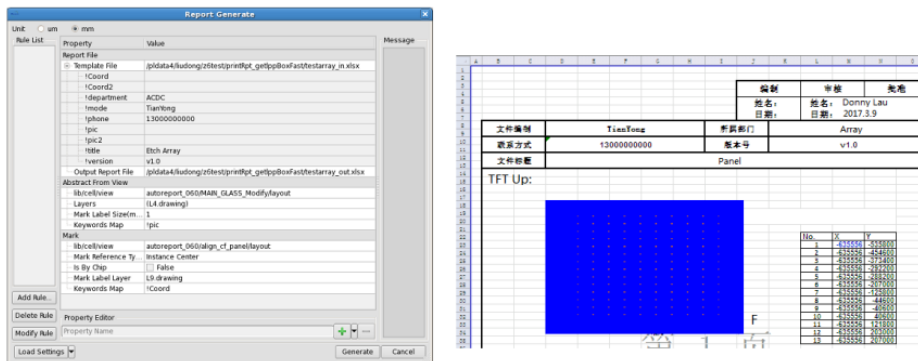
图示3-Split Panel

- Mosaic Analysis：用以在切割线周围为AA array的每个Shot分别创建随机的马赛克cells，如图示4所示。



图示4-马赛克分析

- EmapFPD-Job File：Job File自动提取工具，根据用户的Excel模板自动提取缩略图，创建不会失真的矢量图并插入Excel表格中，自动提取Mark坐标，自动填写表格内容，极大提高工艺文件提取效率，如图示5所示。



图示5-Job File根据模板自动创建工艺文件